

大学院先端科学研究部附属
半導体研究教育センター

**Forefront Research and Education Center for Semiconductors
in Kumamoto University**

設置目的

- 最先端の基盤研究からシステム応用までを網羅する半導体研究開発
- 産学官共同研究や国内外の研究機関・企業との連携に取り組む体制構築
- 社会的ニーズに対応した半導体教育カリキュラムを構築
 - 実践的な高度技術者の輩出

センター組織

基盤研究部門

半導体に関するデバイス評価技術、デバイス製造プロセス技術など
基盤研究の推進

先端研究部門

半導体に関する3次元実装技術、LSI設計技術、システム応用技術など
先端研究の推進

先端科学研究部長

センター運営委員会
センター長(委員長)
研究部長, 研究部長補佐
副工学部長, 副研究部長
専任教員, 兼務教員(教授)

半導体研究教育センター

センター長

青柳昌宏 卓越教授

基盤研究部門

- ・ 鈴木 裕巳 特任教授*
- ・ 野口 祐二 教授*
- ・ 中村 有水 教授*
- ・ 谷田部 然治 准教授*
- ・ 宗像 瑞恵 准教授*
- ・ 吉川 浩行 准教授*
- ・ 松尾 拓紀 准教授**

先端研究部門

- ・ 青柳 昌宏 卓越教授
- ・ 飯田 全広 教授*
- ・ 松田 元秀 教授*
- ・ 橋新 剛 准教授*

* 兼務教員 (先端科学研究部 (工学系))

** 兼務教員 (国際先端科学技術研究機構)

基盤研究部門

半導体デバイス評価技術

- ・半導体CMOSセンサー
鈴木 裕巳 特任教授
- ・半導体材料・強誘電体材料
野口 祐二 教授
松尾 拓紀 准教授
- ・デバイス界面物性評価
谷田部 然治 准教授

半導体デバイスプロセス技術

- ・大気圧成膜プロセス
中村 有水 教授
- ・流体応用プロセス
宗像 瑞恵 准教授
吉川 浩行 准教授

先端研究部門

先端実装プロセス

- ・3次元積層プロセス
青柳 昌宏 卓越教授
- ・3次元積層LSI設計
(東京大学との連携)
- ・放熱構造
松田 元秀 教授
- ・デバイス微量因子分析
橋新 剛 准教授

先端システム応用

- ・エッジコンピューティング
飯田 全広 教授

半導体システム設計技術

- ・LSIデバイス設計
(東京大学との連携)

大学院先端科学研究部附属 半導体研究教育センター

設置場所：
オープンイノベーション
センター内
(工学部研究棟III)

産学官一体による半導体研究・人材育成強化

半導体産業



教育・研究機関

